

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
H01L 21/68

(11)
(43)

2001 - 0092914
2001 10 27

(21) 10 - 2000 - 0015581
(22) 2000 03 27

(71) 3 416

(72) 926 703
14 102 802

(74)
:

(54)

가 가 가 . , 가 가
가 가 .

2

1

2

3

* * .

38: . 40: (chuck).

42:가 (guide ring). 44: (shadow ring).

42a, 44a: 1 2 .

42b, 44b: 1 2 .

A1, A2: 1 2 . S: .

W: .

가 (Eelectrical Static Chuck) (chuck) ,

가 가 (arcing) , 가

1 , (10) (12a) 가 (12a) (가 (12a) (16) 가 (12a) (12a) (14) 가 (12a) (16) 가 (12a) 가

가 (14) (12) 가 (12a) (14a) (16)가 (12a) 가 (14b) (14a) (16)가 가 (14) (14a) (12a) (16)가 가

, 가 (16) (14) (14b) (18) (16) 가 (14), (16) 가 (18) 가 (16) 가 (14) (14b) (18) 가 가 (16) 가 (14) (14b) (18) 가 가 (18) 가 가

(12) 가 (18) (12) (12a)

가 가 가 가
 (Si), (SiC) 가

가 가 가 가

2 가 (38) 가 가 (40) (40)
 가 (42) 가 (42) (W) 가 (W) 가 (42)
 (shadow ring, 44) (40)
 1 (A1) 2 (A2) 2 (A2) 1 (A1) ,
 1 2 (A1, A2) (S) 1 (A1)
 1 (A1) 가 (42) 2 (A2) (S)
 (A1) 가 (42) 1 (42a) 1 (W)가 1 (42b)
 1 (42a) (T) (S) 가 (W) 가 (W) 가
 A1) 1 (A1) (W) 1 (42a) (42) 1 (42b)
 1 (42a) (W) 1 (A1) (W) 가
 1 (42b) (D) 1 (42a) (T) 가

가 (42) 1 (42b) (44) 1 (A1)
 (W) (W) 가 (42)
 C) (44) 1 (42b) (44) (Si), (Si)
 (W) 가 2 (44a) (44)
 (W) 가 , 가 (42) 1 (42b) (W) 가
 (42) (W) , (W) 가

, 2 (40) 1 (A1) 가 (() (W) 가 , 가 (He) 1 (A1) 가 (W)

< >

PE - CVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor D

eposition)

200

, 가 1 가 가 (X=0) 가 가 (X> 0) 가 가

3 가 (X)

(, ' ') 100

3 (G) 가 가 80% (X=0) (X> 0) 가 가 가 2 0%

가

1

가 (deep contact)

가

(57)

1.

가 가

가

가

2.

1

가

가

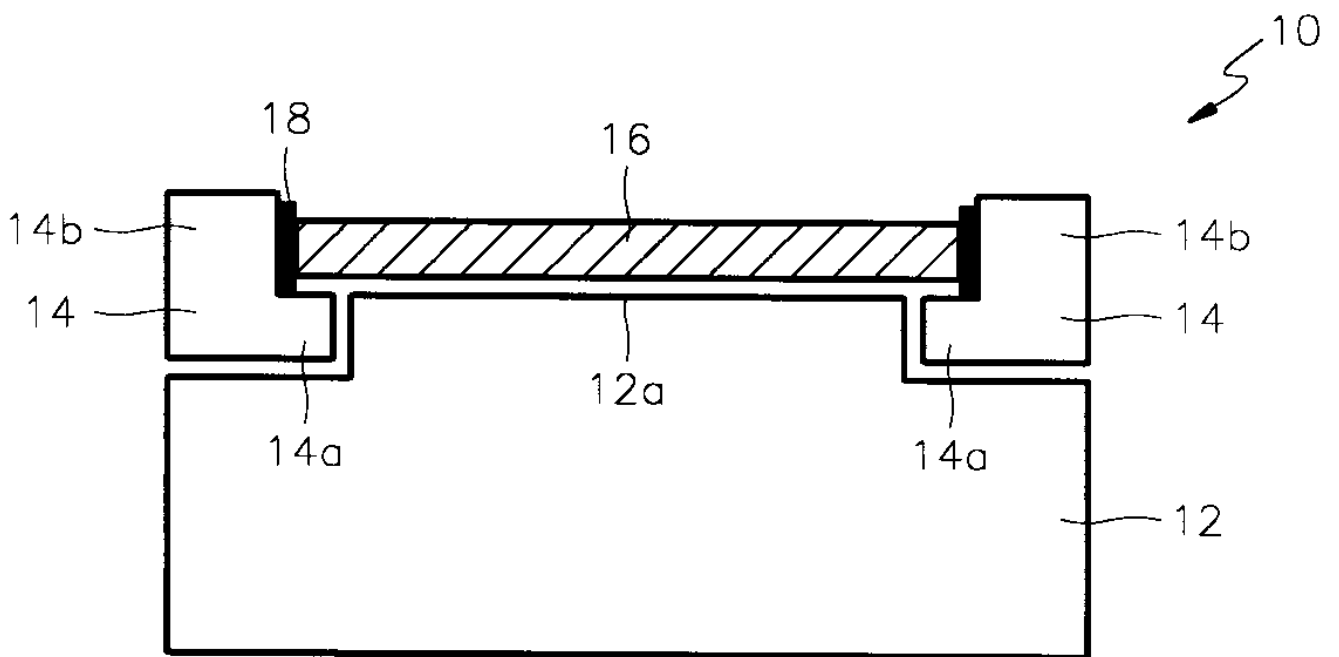
3.

1

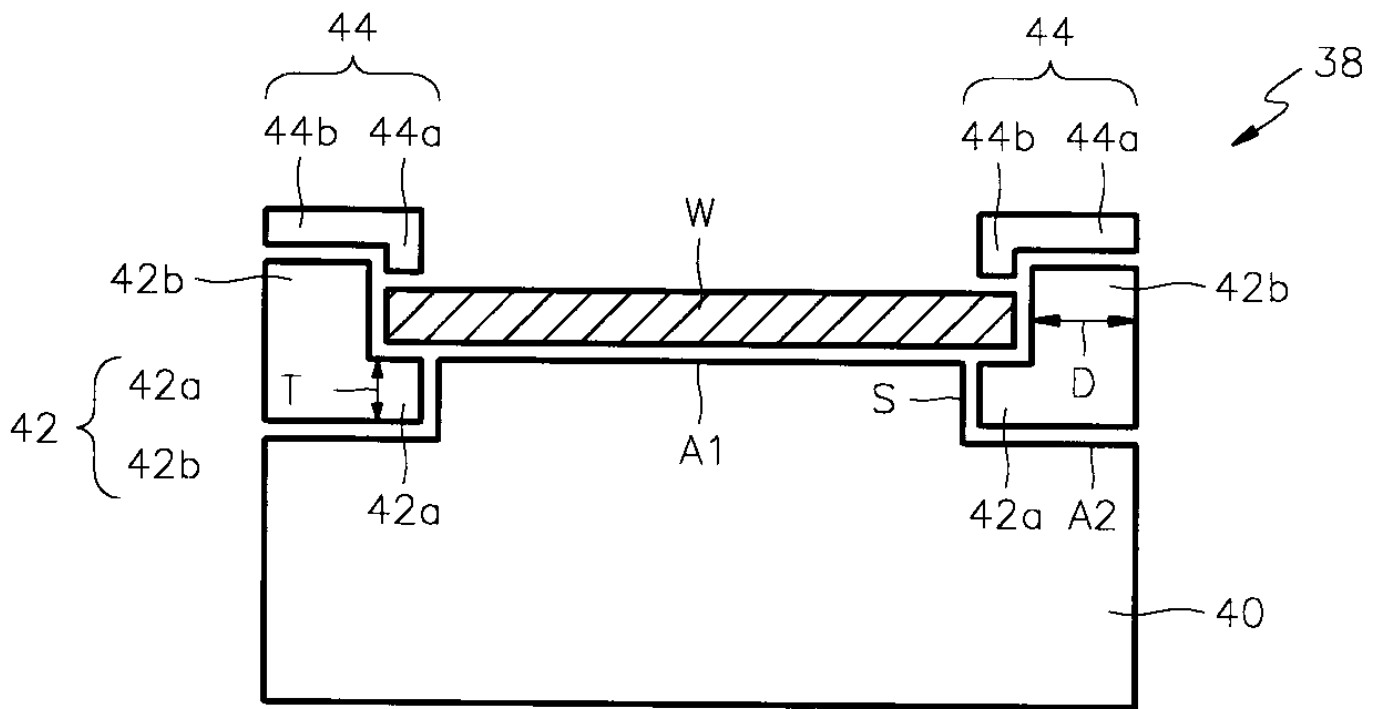
(Si),

(SiC)

1



2



3

